

## CMI 233 快速使用手册

本手册应用范围：16键磁感/涡流双用测厚仪

### A. 磁感型：可测试 非磁性涂镀层/磁性基材（最典型为铁基材） 如何校准（单点校准）



#### 步骤1:

——将SMP-2（或 SMP -1，由仪器的软件版本决定）探头与仪器相联接，如图所示。



#### 步骤2:

——打开电源。观察屏幕显示的测量单位是否与所需的一致(mil或者micron)。按ZERO/UNITS 键调整所需的测量单位。

——按CAL键，您将在屏幕上看到“c”。



#### 步骤3:

——将探头（图示中为SMP-2）稳定的与基材相接触（纯铁），将探头保持接触，同时按归零键ZERO/UNITS（“C”此时会消失）。

——将探头提起后，再次与基材相接触来读取一个读数，确定是否将基材调零。

正常情况下，读数为0.00 mil.

注释：如果您看到读数为”LO -0.00”也是正常的，因为读数不可能低于0.00mil.



#### 步骤四:

——再次按CAL键，并将OICM提供的标准片放置在基材上，将探头接触标准片并进行测试。

——使用键盘上的数字键，输入标准片上所提供的厚度值，按SEL键选取小数点。

——按ENTER键来确认并储存本次校准。

——最后，通过测试基材来确认校准的精确度（读数应为0.00mil）。

也可以通过再次读取标准片来检测校准的精确度。至此您的CMI233就完成了校准。

## B. 涡流型：非导电涂镀层/导性基材（最典型如铜或铝）

### 校准方法(单点校准)：

---



#### 步骤1：

——将ECP探头与仪器连接，如图所示。

---



#### 步骤2：

——打开电源。观察屏幕显示的测量单位是否与所需的一致(mil或者micron)。按ZERO/UNITS 键调整所需的测量单位。

——按CAL键，您将在屏幕上看到“C”。

---



#### 步骤3：

——将ECP探头稳定的与基材相接触（图示中为纯铜），将探头保持与基材接触，同时按归零键ZERO/UNITS(“C”此时会消失)。

——将探头提起后，再次与基材相接触来读取一个读数，确定是否将基材调零。

正常情况下，读数为0.00 mil.

注释：如果您看到读数为” L0 -0.00”也是正常的，因为读数不可能低于0.00mil.

---



#### 步骤四：

——再次按CAL键，并将OICM提供的标准片放置在基材上，将探头接触标准片并进行测试。

——使用键盘上的数字键，输入标准片上所提供的厚度值，按SEL键选取小数点。

——按ENTER键来确认并储存本次校准。

——最后，通过测试基材来确认校准的精确度（读数应为0.00mil）。

也可以通过再次读取标准片来检测校准的精确度。至此您的CMI233就完成了校准。

---

## 更精密的两点校准（以下操作说明对于磁感和涡流模式均适用）



### 步骤1:

——将任一所需的探头与仪器连接后，按CAL。您将在屏幕上看到” C”。



### 步骤2:

——保持探头与基材紧密接触，并按ZERO/UNITS键（C将消失）。  
——将探头提起后，再次与基材相接触来读取一个读数，确定是否将基材调零。  
正常情况下，读数为0.00 mil.



### 步骤3:

——按顺序按\*, CAL键，您会看到屏幕左上角显示C1字样。



### 步骤4:

——选择较薄的标准片置于基材上，将探头与标准片保持紧密接触，此时会看到屏幕上显示读书，如果与标准片上的值不符，则：  
——使用键盘上的数字键，输入标准片上所提供的厚度值，按SEL键选取小数点。  
——按ENTER键来确认并储存本次校准#1。同时您会在屏幕左上角看到C2字样。  
同样的，将较厚的标准片置于基材上，将探头与标准片保持紧密接触，运用键盘输入读数完成校准。  
——最后，通过测试基材来确认校准的精确度（读数应为0.00mil）。也可以通过再次读取两片标准片来检测校准的精确度。至此您的CMI233就完成了校准。

### 基本疑难解答:

如果您无法完成对仪器的校准，请尝试一下操作:

- 开启CMI233, 按\*9191。该操作会重设仪器为出厂模式并自动关闭。
- 再次开启CMI233, 按\*111以及ENTER键。该操作将自动校准探头，同时仪器自动关闭。
- 开启CMI233并根据上面描述的校准操作说明重新校准仪器。

如果您在执行上述操作后仍旧在使用中遇到问题，请与OICM的服务支持团队联络。